

## 期刊信息

篇名	Deformation measurement of RF MEMS switches by optical interference
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Yu Ying,Peter Grant
第一作者单位	
刊物名称	Microelectronics Reliability
页面	Vol.44, pp951-955
出版日期	2004年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">T型触点射频MEMS开关的制备及其形变的光学干涉法研究</a>